

Title (en)  
VACUUM SYSTEM

Title (de)  
VAKUUMSYSTEM

Title (fr)  
SYSTÈME À VIDE

Publication  
**EP 3702622 A1 20200902 (DE)**

Application  
**EP 19159473 A 20190226**

Priority  
EP 19159473 A 20190226

Abstract (en)  
[origin: JP2020139499A] To provide a vacuum system with a vacuum pump and a recipient, each having a functional side, and with a mounting device preferably for vacuum-tight mounting of the vacuum pump on the recipient on functional sides facing each other. SOLUTION: The mounting device is formed to make it possible to initially support, namely by engagement or by insertion, a vacuum pump 11 on a recipient 13 and then attaching the vacuum pump to the recipient. The mounting device comprises at least one support member protruding from its functional side on the recipient side and at least one counterpart on the vacuum pump. The counterpart can be meshed by engagement from above or by insertion from the side in order to support the vacuum pump in a pre-fixing position on the recipient. The mounting device includes, in addition to the support member and the counterpart, fixing means 19 formed on the recipient and on the vacuum pump. SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft ein Vakuumsystem mit einer Vakuumpumpe und einem Rezipienten, die jeweils eine Funktionsseite aufweisen, und mit einer Montageeinrichtung zur vakuumdichten Montage der Vakuumpumpe an den Rezipienten mit einander zugewandten Funktionsseiten, wobei die Montageeinrichtung dazu ausgebildet ist, zunächst ein Abstützen, nämlich durch Einhängen oder durch Einschieben, der Vakuumpumpe an dem Rezipienten und dann ein Befestigen der Vakuumpumpe an dem Rezipienten zu ermöglichen, wobei die Montageeinrichtung am Rezipienten wenigstens ein von dessen Funktionsseite abstehendes Stützorgan und an der Vakuumpumpe zumindest ein Gegenstück umfasst, das mit dem Stützorgan durch Einhängen von oben oder durch Einschieben von der Seite in Eingriff bringbar ist, um die Vakuumpumpe in einer Vorfixierstellung an dem Rezipienten abzustützen, und wobei die Montageeinrichtung zusätzlich zu dem Stützorgan und dem Gegenstück am Rezipienten und an der Vakuumpumpe ausgebildete Befestigungsmittel umfasst, mit denen die Vakuumpumpe entweder direkt in der Vorfixierstellung oder nach einem Überführen aus der Vorfixierstellung in eine Endfixierstellung an dem Rezipienten befestigbar ist.

IPC 8 full level  
**F04D 19/04** (2006.01); **F04D 29/60** (2006.01); **F04D 29/64** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**F04D 19/04** (2013.01); **F04D 29/601** (2013.01); **F04D 29/64** (2013.01); **F04C 25/02** (2013.01); **F05D 2260/33** (2013.01); **F05D 2260/36** (2013.01)

Citation (search report)  
• [X] EP 2228540 A2 20100915 - PFEIFFER VACUUM GMBH [DE]  
• [X] US 2008309071 A1 20081218 - CARBONERI ROBERTO [IT], et al  
• [X] US 2016195095 A1 20160707 - COBBETT ANDREW [GB]  
• [X] CN 108930656 A 20181204 - SHIMADZU CORP

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3702622 A1 20200902**; JP 2020139499 A 20200903; JP 6921253 B2 20210818

DOCDB simple family (application)  
**EP 19159473 A 20190226**; JP 2020022274 A 20200213